一表面に於ける無輻射遷移過程

(Photo Calorimetric Detection)

東北大学工学部 近藤泰洋

はじめに

吸収された光エネルギーが結晶内で無輻射遷移より消費される際構造変化等を引き起こす 場合がある。 結晶全体として収入(光吸収)と支出(フォトン、フォノン、電子、イオ ン等の放出)と蓄積(準安定状態)への割振りを知ることがこのような反応過程を理解す る上で必要となる。 一例としてアルカリハライドの場合を挙げると、X線等の照射によ り励起子が生成された時、この励起子が緩和する分岐として自己束縛励起子(STE) – 発光という過程及びF-H対生成が観測されている。

励起子発光の効率は励起光の波長に依存し、特に吸収係数の大きな領域で効率が減少する ことが知られている、 この減少は励起子が結晶の表面付近で生成されるため無輻射的に再 結合するためと理解されている。 西村¹¹はKI及びRbIに於て、 S T E による発光の励起ス ペクトル及び反射スペクトルにみられる構造を解析し、 励起子が拡散により表面に到達し た場合は無輻射遷移により消滅するものとしてこれらの構造を説明すると共に吸収係数を 求めた。 しかし柳原ら⁽²⁾によれば吸収係数の大きな領域で必ずしも発光効率の低下が見ら れる訳ではないことも指摘されており、 表面付近での励起子の挙動(特に緩和過程)はま だ良く理解されてはいない。

励起子への表面の影響としては励起子の大きさ程度の表面数層内部での生成、結晶内部で 生成された後表面への拡散の二つの場合が考えられる。 これらの影響を分離して観察す るには、結晶を小さくして励起子の減衰(発光、欠陥生成及び無輻射遷移による)を観測 すれば良いであろう。 その際指標となる大きさとしては励起子の拡散長及び励起子自身の 大きさの二つが考えられる。

本研究では上記のような予想のもとにバルクでの性質が良く調べられているKIとAgCl(共に自己束縛励起了を形成する)を用いて、 蒸着膜及びガス中蒸発による微結晶試料における励起子の発光及び無輻射遷移の効率測定及び生成された欠陥の検出を計画した。

無輻射効率の測定

吸収された光エネルギーは緩和や構造変化により一部が、また無輻射結合により全部 がフォノンに変換され、試料の温度上昇に寄与する。この試料の温度上昇を検出する方法 として最もよく知られているのはPAS(Photo Acoustic Spectroscopy)である。 しか し、PASは検出の手段として気体を利用しており低温での測定には向かない。 従って ここでは、赤外光検出器に用いられているボロメーターと同じ原理に従う光カロリメトリ ックな手段を用いた。 すなはち試料の温度 上昇を高感度のゲルマニウム温度センサーで 検出する方法であり、 ポロメーターは試料= 検出子と言う特殊な場合と見なせる。 試料及び検出子は熱容量を最小に抑えるため

0.35K迄冷却される(~10⁻⁹J/K)。

用いたゲルマニウム抵抗の 0.35 K に於ける 抵抗値及びその温度係数は夫々、 2 k Ω、 1 5 k Ω / K であるから、 この抵抗に 1 μ A の

電流を流したとき 0. 1 μ V 迄の電圧変化を



図1 光カロリメトリー分光用セル

検出し得るとすると~10⁻¹⁴Jの熱量変化を検出できる。 このエネルギーは~10⁵フォト ンであり通常の光源を用いて十分な分解能で熱発生効率スペクトルを得られる感度である。 ゲルマニウム抵抗及び試料(サファイア基板)は図 1 の様に配置され、相互は 0.1 ¢ mmの金 線で熱的に結合されている。 このシステムで試料に吸収された光エネルギーの絶対値や 発生した熱量、フォノン数などの絶対値を知ることは困難である。 しかし発生した熱量 (温度変化、以下では PCSと略記する)と発光強度(以下では Lumiと略)の比、 PCS/Lumiを 考えると

PCS $\propto n_{\alpha} \pi \omega_{\alpha} - n_{\alpha} \eta_{1} \cdot \pi \omega_{\alpha} - n_{\alpha} \eta_{x} \cdot X$

Lumix na n.

と表される。 ここで n_αは吸収されたフォトンの数、 ω_α、ω_eは入射光と発光の角周波数、 η_L は発光の量子効率、 X および η_x は準安定状態の持つエネルギーとその生成効率を表す。 反射及び透過の影響を取り除くため PCSと Lumiの比を考えると

PCS/Lumix $\pi \omega_{\alpha} / \eta_{L} - \pi \omega_{P} - (\eta_{x} / \eta_{L}) X$

と表され PCS/Lumiは 試料に実際に吸収された光量を求める 事なく得られ、 発光効率 n_Lが小 さくなると増加する。 また n_L が一定ならば直線となり、 n_x を無視すれば Pcs/Lumi = 0と置 いて n_Lを求めることが出来る。 此の光カロリメトリーによる方法は実際に吸収された光エ ネルギーのみに依存するため白濁した物質や微少吸収の測定に適している。

試 料

用いたKI, AgC1試料は以下の通りである。

ΚI	単結晶:	$5 \times 5 \times 1 \text{ mm}^3$		AgCl	単結晶:	5 x 5 x 0.	2 m.m. ⁻
	蒸着膜:	500A (平均膜厚,	サファイア		蒸着膜:	300A (平均	膜厚、
		200 A	基版)			150 A	NaC1基板)
		50 A				25 A	

石英るつぼ中の試料をニクロム線ヒーターで加熱、 膜厚モニターで平均膜厚を見ながら蒸 着を行なった。 蒸着後クライオスタットに装着するまでの数分間、 試料を空気中に晒さざ るを得ず、 目下改良中である。 AgC1蒸着膜は測定後電子顕微鏡で観察したところ、 300A

(29)

以上の膜厚では基板を一様に覆っていたが、150A以下の膜厚では島状であった。 KI試料の電顕による観察は行ってはいない。 しかしながら、AgC1からの類推から500A厚試料は薄膜、200A, 50A膜は島状の試料と思われる。

結果及び考察

1) K I

図2に単結晶試料に於て得られた STEによるπ発光の励起スペクトル、熱 発生(以下PCSと略する)のスペクトル を示す。 5.9 eV付近に見られるへこみは反射 率のピークに対応し、吸収光量の減少を示す。 図3に両者の比、 PCS/Lumiのスペクトルを 示す。前項で述べたようにPCS/Lumiのスペク トルは吸収光量には依存しないので反射によ る寄与は取り除かれている。図3には西村い により求められた吸収係数のスペクトルも同 時に示してある。 図から吸収係数の大きい 領域では発熱効率の比は大きく表面付近で励 起子が無輻射的に消滅している事を示唆して いる。発光効率に見られるゼロフォノン線と 一致する所でPCS/Lumiにも小さなピークが見 られ両者は良く一致している。



図 3 単結晶 KIの PCS/Lumi (実線) と吸収係数 (点線)のスペクトル

図4 に平均膜厚 (a) 500 A, (b) 200 A, (c) 50 A の 3 試料における PCS, Lumi, PCS/Lumi の各々のスペクトルを示す。単結晶の場合と比較してゼロフォノン線は明瞭ではないが励 起子の遷移エネルギーは約0.04 eVほど低エネルギー側にシフトしている。 50 A 膜試料では 反射によるへこみは小さく発光励起スペクトルには単結晶の吸収スペクトルに見られるゼ ロフォノン線に対応する遷移によると思われるピークは見られるが、 PCS/Lumiのスペクト ルにおいては単結晶試料でみられた強い無輻射遷移によるピークが見られない。

1S励起子の拡散長が150A¹⁾であることを考えると生成された励起子は総て発光を伴わずに 無輻射的に消滅するはずであるがまだ図に示されるように π 発光は観測されている。 おそ らく発光効率の絶対値が低下し、 PCS/Luniが平坦化していると思はれる。

2) AgC1

AgC1は520nm付近に巾の広いSTE発光を示しその発光効率は約30%である。 柳原ら²)に よればAgC1直接励起子による反射ピークの補正を行って得た発光効率はK1と異なり励起子



図 5 にAgC1単結晶について得られたPCS, Lumi, PCS/Lumiのスペクトルを示す。 直接励 起子帯より高エネルギー側でのPCS/Lumiに見 られるステップ状の増加は此の領域より高エ ネルギー側では吸収係数が大きいためにKIの 場合と同様な表面への励起子拡散が起きてい る為と考えられる。 蒸着膜試料に於ける結果 を図 6 に示す。 PCSに見られる励起子吸収ピー クの位置は膜厚に依存して居らず、 このサイ



ズまでの領域では励起子がまだ十分小さく励起子遷移へのサイズ効果は現れていない事を示している。 150A以下ではPCS/Lumiスペクトルに直接励起子ピークを境にしたステップ状の増加が見られなくなる事から励起子の拡散長は~150A程度と見積られる。



終わりに

光カロリメトリック検出法は白濁物質にも適用できることから、ただ一層では吸収強度が弱いと予想される微結晶中の欠陥の検出には積層する事により吸収強度を増加させることが出来、有効な方法と思われる。本研究では基板上に薄く蒸着した試料についての結果を示したが、目下ガス中蒸発させた試料を基板上に厚く堆積させPCS及び発光の励起スペクトルの測定を行なう事を計画している。これまでの測定は試料表面への拡散長程度の試料サイズについて測定を行ってきたが、励起子そのもののサイズと同程度或はそれ以下の大きさの微結晶における同様な測定及び生成された欠陥の検出を目指している。

参考文献

1) H. Nishimura, J. Lumin. 31, 32(1984)105.

2) M. Yanagihara, Y. Kondo, and H. Kanzaki, J. Phys. Soc. Jpn. 52(1983)4397